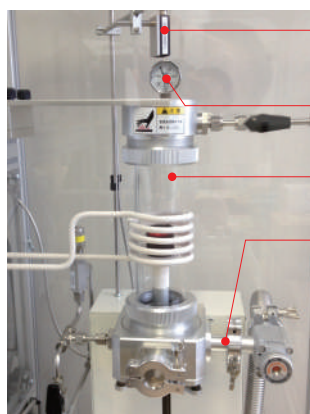




導入事例：架台一体型熱処理装置
主な構成
MU- α Ⅳ・UD-250・真空ポンプ・真空計・ガス流量調節計・安全保護カバー付

特 長

- 不活性雰囲気(大気圧)による加熱処理を手軽に実現
- 小型高周波誘導加熱装置MU- α Ⅲ/Ⅳとの組み合わせで2000℃の高温加熱を卓上サイズで実現
- ステージ昇降式で試料の出し入れがスムーズで簡単



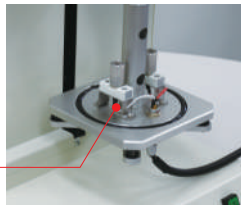
- 温度測定(放射温度計:別売品)
非接触で温度測定可能
- 負・正圧力表示(連成計 ϕ 40)
- 透明石英ガラス管(両切)
- 真空排気口(NW16用×2ポート)
ガス吸排気口(1/4インチ配管用×2ポート)
給・排気バルブ付
- 温度設定(熱電対:別売品)
導入端子・接続ケーブル付

仕 様

型 式	UD-250
外 径 寸 法	本体部 210(W)×340(H)×240(D)mm
	置換部 110(W)×280(H)×110(D)mm
重 量	15kg
電源電圧(消費電力)	AC100-AC200V±10% 50/60Hz (25W)
容 器 寸 法 (容 量)	ϕ 60×220(H)×3(T)mm (500cc)
真 空 到 達 度	6.7×10^{-3} (Pa) 初期値※1
昇 降 速 度	Hi-Low 2段切替(865-53mm/min)

※1 到達真空度は排気装置の能力による

自動昇降式ステージ



放射温度計(別売品)



測定レンジは4タイプ
200-2000℃・300-2000℃
600-2000℃・600-3000℃

ご注意: MU-1700/2000シリーズは生産中止しました。MUシリーズの全機種に使用できます。

- 本製品は耐薬品性、耐衝撃性等を保証するものではありません。お客様の判断で用途に合わせてご使用ください。
- 本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2014年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- 製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。

©2013 by SK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.